

[研究論文] KIT-6 をテンプレートとしたメソポーラス酸化チタンの合成過程 一分析電子顕微鏡システム利用研究成果、その XXV (3) —

伊藤友貴¹・丹羽紘一¹・伊熊泰郎¹

1 応用化学科

Observation of mesoporous titanium dioxide synthesis process —Research works accomplished by using Electron Microscope System: XXV (3)—

Yuuki ITO¹, Koichi NIWA¹, Yasuro IKUMA¹

Abstract

Using amorphous mesoporous SiO₂ (KIT-6) as a template, mesoporous TiO₂ powder was synthesized by exchanging Si for Ti. The process was examined by TEM and X-RD. Just after the exchange reaction, the microstructure of TiO₂ was almost the same as that of mesoporous SiO₂ (KIT-6). The distance between the neighboring mesopores was slightly expanded. It was still in amorphous phase. Once the powder was heated to 600°C, TiO₂ crystallized to anatase phase. The microstructure of crystalline phase was similar to that of mesoporous SiO₂ with smaller distance between the neighboring pores. The shape of pore was not as clear as amorphous SiO₂.

Keywords: mesoporous TiO₂, template method, mesoporous SiO₂, anatase TiO₂

1. はじめに

金属酸化物を合成する場合、その金属イオンを含む水溶液に沈殿剤を導入し、沈殿をろ過、か焼して合成する。この方法の生成物（沈殿をか焼したもの）は表面積が5～20 m²/g（酸化ジルコニウムの場合⁽¹⁾）の通常の粉末になる。一方、微構造を制御した粉末、特に高比表面積メソポーラス粉末は触媒などの用途が考えられるため、その合成法を確立することは重要である。界面活性剤を用いて合成したメソポーラスシリカをテンプレートとして、高比表面積金属酸化物を合成する手法⁽²⁾（テンプレート法）を用いて Tuysuz ら⁽²⁾は Co₃O₄系酸化物を合成した。本論文の著者の何人かは、Tuysuz らと類似の手法を用いてメソポーラス酸化チタンを合成した⁽³⁾が、その合成過程の変化は良く分かっていない。そこで、本研究ではテンプレート法によるメソポーラス酸化チタン合成過程の一部を理解することを目的とした。

2. 実験方法

チタンのアルコキシドは水との反応が非常に速いため、

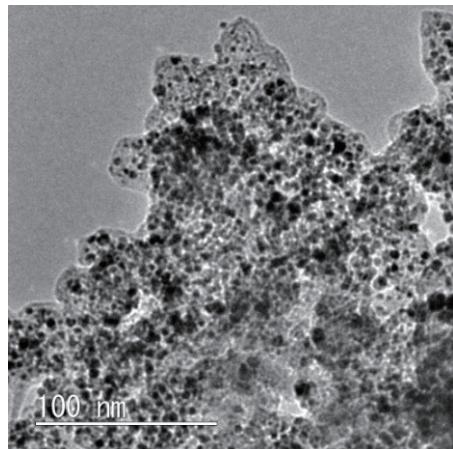
これを用いた反応を制御してメソポーラス酸化チタンを合成することは困難である。一方、ケイ素のアルコキシドは水との反応が遅いので、メソポーラス酸化ケイ素を合成する方法は確立⁽⁴⁾している。本研究では、3次元の秩序構造をとる KIT-6 (SiO₂である)を合成⁽⁴⁾し、その Si を Ti で置換する手法を用いて、メソポーラス酸化チタンを合成することにした。

界面活性剤と TEOS (テトラエトキシシラン) を用いて、KIT-6 (未か焼) を合成した⁽⁴⁾。これを 540°C でか焼することで、KIT-6 (540°C か焼後) とした。これがシリコンテンプレートである。次にこのシリコンテンプレート粉末とチタンイソプロポニドを混合し、90°C で 24 h 加熱することにより、Si と Ti の置換反応を進行させた。さらに、150°C で 24 h 乾燥した。これを TiO₂ (未か焼) とする。次に、これを酸素気流中、600°C で 5 h か焼して TiO₂ (600°C か焼後) を作製した。これら 4種類の試料を粉末X線回折(X-RD) と透過型電子顕微鏡(TEM) で評価した。

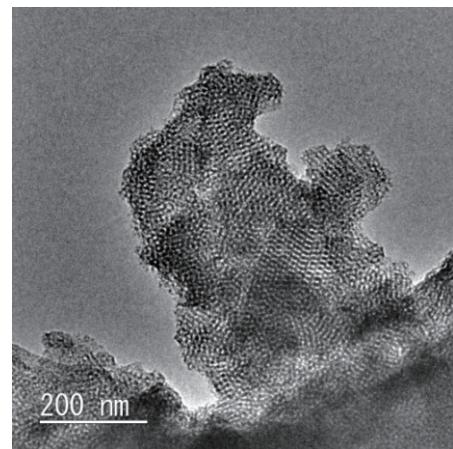
X-RDにはRigakuのRINT 2500VHFを用い、管電流200 mA、電圧50 kV、スキャンスピード4.0°/minの条件で測定した。TEMにはJEOLのJEM2100を用い、加速電圧200 kV、倍率40,000～80,000倍の条件で観察した。

3. 実験結果と考察

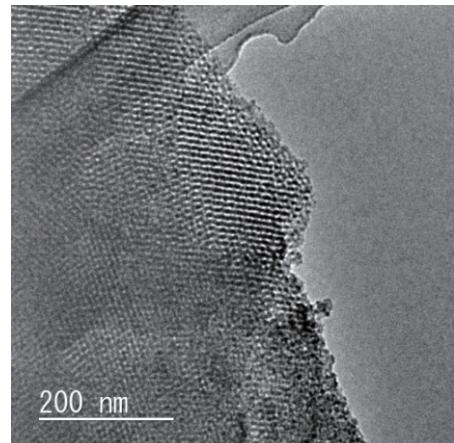
本研究で得られた4種類の試料のTEM観察結果を図1に示す。KIT-6(未か焼)(図1(a))は10nm以下の粒子の集合体である。X線回折で調べた結果、何のピークも得られなかつたので、非晶質の微粒子が集合した粉末である。これを540°Cでか焼したものがKIT-6(540°Cか焼後)でそのTEM写真を図1(b)に示す。図から、100~200nmの粒子の集合体であることが分かる。すなわち、KIT-6(540°Cか焼後)はKIT-6(未か焼)より粒成長した。この粒子には黒い線状部分と白い線状部分が交互に存在し、メソポーラスであると言える。なお、この線状部分の長さは最大でも200nm位であるが、この写真からは3次元の秩序構造であることを確認できない。それでも、きれいな線状部分があるので、KIT-6(未か焼)より結晶性は高くなつたと考えられる。しかし、KIT-6(540°Cか焼後)のX線回折図(図2の(a))はこの試料が結晶質でなく、非晶質であることを示している。 $2\theta=23^\circ$ 付近に幅広いピークが見られるところから、第1近接原子の距離はほぼ一定であるが、第2近接原子以後は一定ではないと思われる。



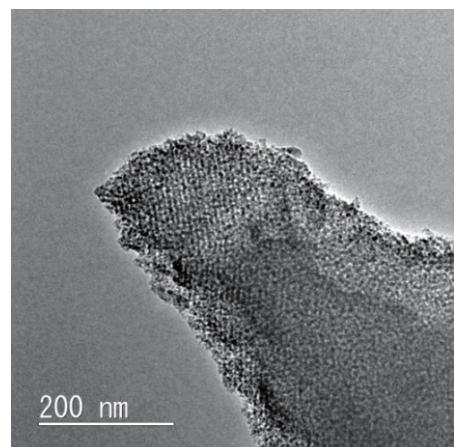
(a)



(b)



(c)



(d)

図1. 試料のTEM画像。(a) KIT-6(未か焼), (b) KIT-6(540°Cか焼後), (c) TiO_2 (未か焼), (d) TiO_2 (600°Cか焼後)

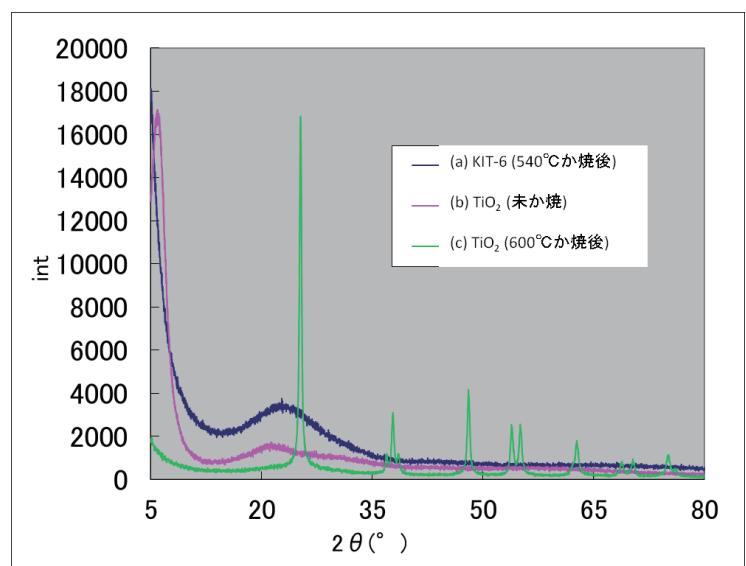


図2. X-RD結果。(a) KIT-6(540°Cか焼後), (b) TiO_2 (未か焼), (c) TiO_2 (600°Cか焼後)

KIT-6 (540°Cか焼後)の Si を Ti で置換した TiO_2 (未か焼)は図 1 (c)に示すとおり、KIT-6 (540°Cか焼後)とほぼ同じような微構造である。つまり、KIT-6 (540°Cか焼後)の構造を維持したまま Si が Ti に置換わったようである。類似の系の EDX で示された⁽⁵⁾ように、Si が数 10 %残留している。X 線的には図 2 の(b)に示すとおり、結晶性は KIT-6 (540°Cか焼後)とほぼ同じで悪く、幅広いピークが $2\theta = 23^\circ$ から 21° に移動した。つまり、第 1 近接原子の距離が長くなった。この TiO_2 (未か焼)を 600°Cでか焼した TiO_2 (600°Cか焼後)は図 1 (d)に示す微構造で、 TiO_2 (未か焼)より白い線状部分弱くなつた。X 線回折の結果(図 2 の(c))は明らかに結晶性が高いことがわかる。これらのピークは全てアナターゼ型 TiO_2 のピークに対応する。図 2 の(c)を良く観察すると、 $2\theta = 15^\circ \sim 30^\circ$ 付近にブロードなピークがあり、少し非晶質な成分が残存していると思われる。

図 1 (b)の KIT-6 (540°Cか焼後)と図 1 (c)の TiO_2 (未か焼)はほぼ同じように見え、図 1 の(d)の TiO_2 (600°Cか焼後)では黒い線状部と白い線状部の区別が弱くなつたように思える。この白い線状部は試料の厚さが薄いのでメソ孔があついている部分と思われる。この白い部分と隣の白い部分の間の長さを測定した結果を表 1 に示す。この表の値は同一試料で 100 ヶ所のメソ孔間距離を測定した平均値である。KIT-6 (未か焼)ではメソ孔が認識できないので、測定できなかつた。KIT-6 (540°Cか焼後)のメソ孔間距離 (8.4 nm)は文献値 (4~12 nm)⁽⁴⁾と比べて妥当な値である。これを構成する Si を Ti で置換した TiO_2 (未か焼)では、メソ孔間距離は 10.2 nm と少し大きくなつた。これは、Si⁴⁺のイオン半径 0.041 nm より Ti^{4+} のイオン半径 0.068 nm が大きいことに関係している。つまり、メソ孔の周囲の骨格構造が大きくなつたため、相対的にメソ孔が大きくなつたものと考えられる。 TiO_2 (600°Cか焼後)のメソ孔間距離が短くなつたのは結晶化が進行し、Ti-O の原子間距離が短くなつたからで、焼結が進行したことも影響している。

表 1. 試料の平均メソ孔間距離の測定値

試料	平均メソ孔間距離 (nm)
KIT-6 (未か焼)*	—
KIT-6 (540°Cか焼後)	8.4
TiO_2 (未か焼)	10.2
TiO_2 (600°Cか焼後)	7.1

* メソ孔が観察されなかつたのでメソ孔間距離は測定しない

4.まとめ

メソポーラス酸化ケイ素 KIT-6 の Si を Ti で置換することでメソポーラス酸化チタンを合成する方法において、物質の微構造変化を TEM で、結晶構造変化を X-RD で調べた。その結果、メソポーラス酸化ケイ素 (KIT-6 (540°Cか焼後)) は平均メソ孔間距離が 8.4 nm の構造で、非晶質であ

った。この Si を Ti で置換すると、微構造も非晶質状態も維持したまま Ti に置換わることが明らかとなつた。 Ti^{4+} のイオン半径が Si⁴⁺のイオン半径より大きいため、置換直後の TiO_2 (未か焼)のメソ孔間距離は大きくなつたが、非晶質のままであつた。これを 600°Cに加熱した TiO_2 (600°Cか焼後)は結晶で、メソポーラスな状態を維持していたが、メソ孔の形が小さくなつた。

参考文献

- [1] Y. Ikuma, K. Komatsu, and W. Komatsu, *Adv. Ceram.*, 24, 749–758 (1988).
- [2] H. Tuysuz, E. L. Salabas, E. Bill, H. Bongard, B. Spliethoff, C. W. Lehmann, and F. Schuth, *Chem. Mat.*, 24, 2493–2500 (2012).
- [3] S. Anandan, Y. Ikuma, K. Kakinuma, and K. Niwa, *NANO*, 3 [5] 367–372 (2008).
- [4] F. Kleitz, S. H. Choi, and R. Ryoo, *Chem. Commun.*, 2003, 2136–2137 (2003)..
- [5] 篠川寛、神奈川工科大学応用化学科卒業論文 (2014 年 3 月).